## Seek control system based upon a detected temperature of a positioning mechanism in a disk device

Patent Number:

US5594603

Publication date:

1997-01-14

Inventor(s):

MORI KAZUNORI (JP); SASAMOTO TATURO (JP); SUZUKI NOBUYUKI (JP)

Applicant(s)::

FUJITSU LTD (JP)

Requested Patent:

JP7153208

Application Number: US19940326471 19941020

Priority Number(s): JP19930302467 19931202

IPC Classification:

G11B5/596; G11B33/14; G05B11/01

EC Classification:

G11B5/55D1D2, G05B19/404, G11B5/55D4

Equivalents:

JP2902921B2

#### Abstract

A seek control system in a disk system, in which the object measured is a mechanism including a voice coil motor which positions a head, and in which the temperature of the voice coil motor is detected and seek operations are controlled based on the thus detected temperature, includes a unit for determining the amount of heat causing the temperature rise of the object under measurement as the square of a voice coil motor current command value multiplied by predetermined coefficients; a unit for integrating the result obtained by subtracting the amount of naturally radiated heat from the amount of heat including the amount of heat causing the thus determined temperature rise, to determine the amount of heat in the object; and a unit for detecting the temperature of the object in accordance with the thus determined amount of heat in the object. Preferably, a calculation concerning the ratio of the amount of heat in the object to the thermal capacity of the object is performed to detect the temperature of the object under measurement.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-153208

(43)公開日 平成7年(1995)6月16日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G11B 21/08

В

B 8425-5D

19/04

501 Q 7525-5D

33/14

501 D

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 15 頁)

(21) 出願番号

(22)出顧日

特願平5-302467

平成5年(1993)12月2日

(71)出顧人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 森 和則

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 鈴木 伸幸

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 笹本 達郎

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

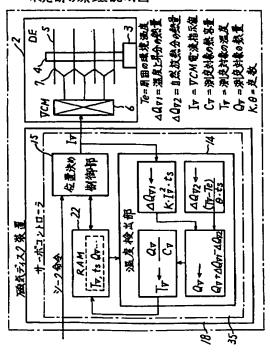
(74)代理人 弁理士 今村 辰夫 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 ディスク装置の温度検出/制御方法

#### (57)【要約】

【目的】 本発明はディスク装置の温度検出/制御方法 に関し、VCMの正確な温度検出を可能とし、検出温度 に基づき、温度が上昇し過ぎないような適切なシークを 可能とし、装置スループット低下を最小限に抑えること を目的とする。

### 本発明の原理 説明図



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ヘッドの位置決めを行うVCM(ポイスコイルモータ)(6)を含む機構部を測定対象として、その温度を検出し、

VCM (6) に対し、前配検出温度に応じたシーク制御を行うディスク装置において、

前記 V C M (6) に対して指示する V C M 電流指示値  $(I_V)$  の2乗に、係数  $(K, t_S)$  を掛けた値を、測定対象の温度上昇分の熱量  $(\Delta Q_{VI})$  として求め、この温度上昇分の熱量  $(\Delta Q_{VI})$  から、測定対象の自然 放熱分の熱量  $(\Delta Q_{VI})$  を差し引いた値を積分  $(Q_V \leftarrow Q_V + \Delta Q_{VI} - \Delta Q_{VI})$  して、測定対象の熱量  $(Q_V)$  を求めることにより、

前記測定対象の温度( $T_V$ )を検出することを特徴としたディスク装置の温度検出方法。

【請求項2】 請求項1記載のディスク装置の温度検出 方法において、

求めた測定対象の熱量( $Q_v$ )と、測定対象の熱容量( $C_v$ )との演算( $Q_v/C_v$ )を行うことにより、前記測定対象の温度( $T_v$ )を検出する( $T_v=Q_v/C_v$ )ことを特徴としたディスク装置の温度検出方法。

【請求項3】 請求項1記載のディスク装置の温度検出 方法で検出した検出温度を、メモリ(22)に保持して おき.

上位装置からシーク命令が発行された場合、前配メモリ (22) に保持してある検出温度に応じて、シーク動作 と、シーク動作の間に、自動的にインターバルを挿入し てシーク制御を行うことを特徴としたディスク装置の制 御方法。

【請求項4】 請求項1記載のディスク装置の温度検出 方法で検出した温度を、メモリ(22)に保持してお

上位装置からシーク命令が発行された場合、前配メモリ (22) に保持してある検出温度に応じて、1回のシーク動作を、複数のシーク動作に分割して実行することを 特徴としたディスク装置の制御方法。

【請求項5】 請求項1記載のディスク装置の温度検出 方法で検出した温度を、メモリ(22)に保持してお き、

前記メモリ(22)に保持してある検出温度に応じて、 冷却ファンの回転の開始、停止、及び回転数を制御する ことを特徴としたディスク装置の制御方法。

【請求項6】 請求項3~5記載のいずれかに記載のディスク装置の制御方法において、

前記検出温度に応じて制御を行う際、制御の開始、終了、及びその処理の内容を、上位装置に報告することを 特徴としたディスク装置の制御方法。

【請求項7】 請求項3~5記載のいずれかに記載のディスク装置の制御方法において、

前記検出温度に応じて行う制御機能を、上位装置から、

コマンド、その他の手段により、設定、及び解除ができるようにしたことを特徴とするディスク装置の制御方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、磁気ディスク装置におけるVCMの過熱対策に利用するディスク装置の過熱対策制御方法に関する。

【0002】近年、磁気ディスク装置の処理高速化要求により、シーク動作を行う時には、VCMに大きな電流を流し、性能を最大限に引き出すようになってきている。そのため、シーク動作を連続して実行していると、過熱によりVCMが破壊されるという問題が出てきており、この問題を解決することが要望されている。

[0003]

【従来の技術】図14~図16は、従来例を示した図であり、図14~図16中、1は磁気ディスク装置(磁気ディスクドライブ)、2はディスクエンクロージャ(以下「DE」と記す)、3はスピンドルモータ、4はスピンドル、5は磁気ディスク、6はボイスコイルモータ(以下「VCM」と記す)、7は磁気ヘッド、9は制御部を示す。

[0004]

§ 1:磁気ディスク装置の説明 ・・図14参照 図14は従来の磁気ディスク装置の説明図である。図示のように、磁気ディスク装置1には、DE2、制御部9 等が設けてある。そして、DE2には、スピンドルモータ3によって回転駆動されるスピンドル4が設けてあり、該スピンドル4には、複数の磁気ディスク5が設けてある。

【0005】また、前配DE2には、制御部9によって制御されるVCM6が設けてあり、このVCM6によって磁気ヘッド7を駆動するようになっている。なお、VCM6のシーク動作は制御部9の制御により行う。

[0006]

82: VCMの過熱対策の説明・・・図15参照 図15は従来の温度検出処理説明図である。前配のよう に、磁気ディスク装置の処理の高速化を図るため、シー ク時にはVCM6に大きな電流を流していた。このよう な大電流によるシークを連続して行うと、VCM6が過 熱し破壊されてしまうことがある。

【0007】そこで、このVCMの過熱対策として、制御部9において次のように制御を行っていた。すなわち、制御部9に、掛算器11、積分器12、比較器13等を設け、これら各部でVCM6の温度を検出し、VCM温度の監視を行うと共に、検出した温度を使用してVCM6に対する過熱対策制御を行っていた。

【0008】前配VCM6の過熱対策制御では、掛算器 11によりVCM電流の2乗の値(コイルの発熱量は電 流の2乗に比例する)を求めて、1秒当たりの発熱量と し、この値を積分器12で積分してVCMの温度(VCMのコイル温度)に近似させる。更に、比較器13により、前配積分器12の出力を基準値と比較して検出信号を求める。

【0009】制御部9では、前記処理により、VCM6の温度を監視し、前記温度が基準値を越えると、前記検出信号により、シーク時の過熱対策制御を行っていた。この場合、過熱対策制御としては、次のような方法があった。

【0010】①:シーク時に、前記温度が基準値を越えていたら、VCM電流を制限することで、VCMの発熱を抑える方法。

②:シーク時に、前記温度が基準値を越えていたら、シーク動作の開始、終了を遅らせることで、VCMの発熱を抑える方法。

[0011]

§ 3: VCM電流、温度の波形説明・・・図16参照 図16は従来のVCM電流、温度波形図である。前記② の方法により、VCMの過熱対策制御を行った場合のV CM電流、温度の波形は図示の通りである。

【0012】図において、①はVCM電流値の波形、②は検出温度を示す波形である。また、t1、t2、t3、t4・・・は各タイミングを示す。この例では、次のように音、御を行う。例えば、シークコマンドが発行されたt1では、検出温度は基準値より低い値である。従って、直ちに図示のようなVCM電流値を設定してシーク制御を行う。

【0013】シークコマンドが発行された t2では、検出温度は基準値より高い値である。この場合、 t2から  $\Delta$  tだけシークを遅らせる。そして、  $t2+\Delta$  t後の t3でシーク制御を行う。

【0014】シークコマンドが発行された t4では、検出温度は基準値より高い値である。この場合、 t4から  $\Delta$  tだけシークを遅らせる。そして、  $t4+\Delta$  t後の t5 でシーク制御を行う。

【0015】シークコマンドが発行された t6では、検出温度は基準値より高い値である。この場合、 t6から  $\Delta$  tだけシークを遅らせる。そして、  $t6+\Delta$  t後の t7でシーク制御を行う。以後同様にして、温度に応じてシーク制御を行う。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】前記のような従来のも のにおいては、次のような課題があった。

(1): VCMの温度検出処理では、VCM電流の2乗の値を1秒当たりの発熱量とし、この値を積分してVCM温度に近似させるだけで、VCM温度の監視を行っている。このため、VCM温度の誤差が大きくなる。

【0017】また、前記検出温度を基に、過熱対策制御を行った場合、誤差の大きい検出温度を使用して制御を行うので、適切な過熱対策制御が出来ない。

(2):前記VCMの過熱対策制御例ののように、VCM 電流を制限する制御では、シーク時間が長くなり(速度が遅くなるため)、スループットの低下が起こる。また、誤差の大きい検出温度に基づいて制御しているので、適切な制御ができない。

【0018】(3):前記VCMの過熱対策制御例①のように、シーク動作の開始、終了を遅らせる制御では、シークを遅らせた分、処理が遅くなる。従って、スループットの低下が起こると共に、スループットの低下が起こる割に、連続してディファレンスの大きいシーク動作を行った場合には、温度抑制効果が小さい。

【0019】本発明は、このような従来の課題を解決し、VCMの正確な温度検出を可能とし、かつ検出した温度に基づいて、VCM温度が上昇し過ぎないような適切なシーク制御を可能とし、装置のスループット低下を最小限に抑えることを目的とする。

[0020]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の原理説明図であり、図1中、図14と同じものは、同一符号で示してある。また、18はサーボコントローラ、14は温度検出部、15は位置決め制御部、22はRAM、35はVCM制御部を示す。

【0021】本発明は上記の課題を解決するため、次のように構成した。

①: ヘッドの位置決めを行うVCM6を含む機構部を測定対象として、その温度を検出し、VCM6に対し、前記検出温度に応じたシーク制御を行うディスク装置において、前記VCM6に対して指示するVCM電流指示値( $I_V$ )の2乗に、係数(K、 $t_S$ )を掛けた値を、測定対象の温度上昇分の熱量( $\Delta Q_{VI}$ )として求め、この温度上昇分の熱量( $\Delta Q_{VI}$ )から、測定対象の自然放熱分の熱量( $\Delta Q_{VI}$ )から、測定対象の自然放熱分の熱量( $\Delta Q_{VI}$ )を差し引いた値を積分( $Q_V \leftarrow Q_V + \Delta Q_{VI} - \Delta Q_{VI}$ )して、測定対象の熱量( $Q_V$ )を求めることにより、前記測定対象の温度( $T_V$ )を検出する( $T_V = Q_V / C_V$ )ディスク装置の温度検出方法。

【0022】②: 構成 $\mathbb{O}$ において、求めた測定対象の熱  $\mathbb{E}$ ( $Q_{\gamma}$ )と、測定対象の熱容 $\mathbb{E}$ ( $C_{\gamma}$ )との演算( $Q_{\gamma}$ / $C_{\gamma}$ )を行うことにより、前記測定対象の温度( $T_{\gamma}$ )を検出する( $T_{\gamma} = Q_{\gamma}$ / $C_{\gamma}$ )ディスク装置の温度検出方法。

【0023】③: 構成①のディスク装置の温度検出方法で検出した検出温度を、RAM22に保持しておき、上位装置からシーク命令が発行された場合、前配RAM22に保持してある検出温度に応じて、シーク動作と、シーク動作の間に、自動的にインターバルを挿入してシーク制御を行うディスク装置の制御方法。

【0024】④: 構成①のディスク装置の温度検出方法で検出した温度を、RAM22に保持しておき、上位装置からシーク命令が発行された場合、前記RAM22に保持してある検出温度に応じて、1回のシーク動作を、

複数のシーク動作に分割して実行するディスク装置の制御方法。

【0025】⑤: 構成①のディスク装置の温度検出方法で検出した温度を、RAM22に保持しておき、前配RAM22に保持してある検出温度に応じて、冷却ファンの回転の開始、停止、及び回転数を制御するディスク装置の制御方法。

【0026】⑥: 構成③~⑤のいずれかに配載のディスク装置の制御方法において、前配検出温度に応じて制御を行う際、制御の開始、終了、及びその処理の内容を、上位装置に報告するディスク装置の制御方法。

【0027】②: 構成③~⑤のいずれかに記載のディスク装置の制御方法において、前記検出温度に応じて行う制御機能を、上位装置から、コマンド、その他の手段により、設定、及び解除ができるようにしたディスク装置の制御方法。

### [0028]

【作用】前記構成に基づく本発明の作用を、図1に基づいて説明する。サーボコントローラ18に設けたVCM制御部35では、位置決め制御部15により、VCM6のシーク制御等を行うが、その際、VCM制御部内の温度検出部14では、温度検出処理を実行し、検出結果のデータ(検出温度等)をRAM22に格納しておく。この温度検出処理は次のようにして行う。

【0029】前記温度検出部14では、先ず、VCM電流指示値を $I_V$ とし、この $I_V$ を2乗した値 $I_V \times I_V$ と、定数K、及びサンプリング時間  $I_S$ との乗算を行うことにより、温度上昇分の熱量 $\Delta Q_{VI}$ を求め( $\Delta Q_{VI}$ =  $K \times I_V \times I_V \times I_S$ )、RAM22に格納する。

 $[0\ 0\ 3\ 0]$  次に、測定対象の温度 $T_v$ 、周囲の環境温度 $T_e$ 、定数 $\theta$ 、サンプリング時間  $t_s$  を使用して、  $(T_v-T_e)$   $/\theta\times t_s$  の演算を行い、自然放熱分の

 $(T_V-T_e)$  /  $\theta imes t_S$  の演算を行い、自然放然力の 熱 $oxtlush \Delta Q_{V2} = (T_V-T_e)$  /  $heta imes t_S$ )を求め、RAM22に格納する。

【0031】続いて、温度上昇分の熱量 $\Delta Q_{v_1}$ から、測定対象の自然放熱分の熱量 $\Delta Q_{v_2}$ を差し引いた値を積分する( $Q_v \leftarrow Q_v + \Delta Q_{v_1} - \Delta Q_{v_2}$ )ことにより、前記測定対象の熱量 $Q_v$ を求め、RAM22に格納する。

【0032】最後に、前配新しい測定対象の熱量Q $_{\gamma}$ と、測定対象の熱容量 $C_{\gamma}$ とを使用し、 $Q_{\gamma}$   $/C_{\gamma}$  の演算(割り算)を行って、新しい温度 $T_{\gamma}=Q_{\gamma}$   $/C_{\gamma}$  を検出し、RAM22に格納する。以上の処理をサンプリング時間  $t_{S}$  毎に行って、測定対象の温度 $T_{\gamma}$  を検出し、検出したデータをRAM22に格納しておく。

【0033】そして、位置決め制御部15がシークを実行する時は、前配RAM22に格納してあるデータを読み出して実行する。この場合のシーク制御方法としては、次のような方法がある。

【0034】①:第1のシーク制御方法は、シーク実行時に、検出した温度が基準値よりも大きかったら、その

値に応じてシークの開始を遅らせる方法である。このよ うにすれば、温度上昇を抑制することができる。

【0035】②:第2のシーク制御方法は、1つのシーク動作を、複数のシーク動作に分割して行う方法である。また、前記シーク制御とは別に、検出した温度を利用して、冷却ファンの回転数を制御する。

【0036】なお、VCM制御部35では、前記シーク制御の開始、終了、及びその処理の内容を、上位装置に報告する。また、前記検出温度に応じて行う制御機能を、上位装置から、コマンド、その他の手段により、設定、及び解除ができるようにすることもできる。

【0037】以上のようにして、VCMの正確な温度検出を可能とし、かつ検出した温度に基づいて、VCM温度が上昇し過ぎないような適切なシーク制御を可能とし、装置のスループット低下を最小限に抑えることができる。

### [0038]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図2~図13は本発明の実施例を示した図であり、図2~図13中、図1、図14と同じものは、同一符号で示してある。

【0039】また、16はプリント板、17は上位コントローラ、19はRAM(メモリ)、20、23はROM(不揮発性メモリ)、21はバッファ、24はディジタル/アナログコンバータ(以下「DAC」と記す)、25、27はドライバ、26はモータコントローラ、28はアナログ/ディジタルコンバータ(以下「ADC」と記す)、29は位置信号作成回路、30はフォーマットコントローラ、31はエンコーダ/デコーダ、32はプリアンプ、33はヘッドIC(集積回路装置)、37は目標速度発生部、38は実速度発生部、39は速度設差信号作成部、40は出力部、43はキャリッジ、44はシャフト、45はベアリング、46は磁石、47は磁気回路、49はコイル、50はベース、51はカバー、52はコイル支持部を示す。

#### [0040]

§ 1:磁気ディスク装置の構成説明・・・図2参照 図2は磁気ディスク装置のブロック図である。図示のように、磁気ディスク装置1はプリント板16と、DE2 とで構成されている。

【0041】そして、プリント板16には、上位コントローラ17、サーボコントローラ18、RAM19、22、ROM20、23、パッファ21、DAC24、ドライバ25、27、モータコントローラ26、ADC28、位置信号作成回路29、フォーマットコントローラ30、エンコーダ/デコーダ31等が設けてある。

【0042】また、DE2には、プリアンプ32、ヘッドIC33、スピンドルモータ3、スピンドル4、磁気ディスク5、ポイスコイルモータ(以下「VCM」と記す)6、磁気ヘッド7等が設けてある。前記各部の機能

等は次の通りである。

【0043】(1):上位コントローラ17は、SCSIインターフェースを介して、ホスト装置との間でコマンドのやりとりをしたり、データ転送等を行ったり、或いは磁気ディスク装置内の各種制御を行うものである。

【0044】(2):サーボコントローラ18は、VCM6、スピンドルモータ3等に対するサーボ制御を行うものである。なお、このサーボコントローラ18には、VCM6の制御を行うVCM制御部と、スピンドルモータ3の制御を行うスピンドルモータ制御部とがある。

【0045】(3): RAM19は、上位コントローラ17がアクセスするメモリである。

(4) : RAM 2 2は、サーボコントローラ1 8 がアクセスするメモリである。なお、このRAM 2 2 には、温度検出処理で使用する各種のデータ(詳細は後述する)を格納する。

【0046】(5):ROM20は、上位コントローラ17がアクセスする不揮発性メモリであり、プログラムやデータを格納しておくものである。

(6): ROM23は、サーボコントローラ18がアクセスする不揮発性メモリであり、プログラムや温度検出処理で使用する各種のデータ(詳細は後述する)を、予め 枠納しておくものである。

(0047)(7): バッファ21は、フォーマットコントローラ30がアクセスするものである。

(8) : DAC24は、サーボコントローラ18から出力 されるディジタル信号(DACの設定値)をアナログ信 号に変換するものである。

【0048】(9):ドライバ25は、DAC24の出力 信号を基に、VCM6を駆動するものである。

(10):ドライバ27は、モータコントローラ26からの 信号を基に、スピンドルモータ3を駆動するものであ ス

【0049】(11):モータコントローラ26は、スピンドルモータ3の回転を制御するものである。

(12): ADC28は、位置信号作成回路29から出力されるアナログ信号(位置信号)を、ディジタル信号に変換するものである。

【0050】(13): 位置信号作成回路29は、プリアンプの出力信号(サーボ信号)から、位置信号を作成するものである。

(14):フォーマットコントローラ30は、磁気ディスク (媒体)5に対するリード/ライトデータのフォーマッ ト処理を行うものである。

【0051】(15):エンコーダ/デコーダ31は、リード/ライトデータのエンコード、或いはデコード処理を行うものである。

(16): ブリアンプ32は、サーボヘッド(磁気ヘッド7の内の1つのヘッド)により、磁気ディスク5のサーボ面から読み出したサーボ信号を入力して増幅するもので

ある。

【0052】(17): ヘッドIC33は、データヘッド (磁気ディスク5に対し、データのリード/ライトを行 う磁気ヘッド)を駆動して、データのリード/ライトを 行うものである。

【0053】(18):スピンドルモータ3は、スピンドル4を介して、磁気ディスク5を回転駆動するものである。

(19): VCM6は、磁気ヘッド7を磁気ディスク5の半径方向に移動させて位置決めするものである。

【0054】(20):磁気ヘッド7は、データヘッドとサーボヘッドで構成される。そして、データヘッドは、磁気ディスク5に対し、データのリード/ライト等を行うために使用し、サーボヘッドは磁気ディスク5のサーボ面からサーボ信号をリードするために使用するものである。

[0055]

§ 2:サーボコントローラの説明・・・図3参照 図3はサーボコントローラの説明図である。図示のよう にサーボコントローラ18には、VCM制御部35が設 けてあり、該VCM制御部35には、目標速度発生部3 7、実速度発生部38、速度誤差信号作成部39、出力 部40等が設けてある。なお、前記各部は 例えば、ファームウエアにより構成される。前記各部の機能等は次 の通りである。

【0056】(1):目標速度発生部37は、目標速度信号を発生させるものである。なお、この目標速度発生部37では、残りシリンダ数に応じた値を、テーブル参照により求め、その値を目標速度として発生する。

【0057】(2): 実速度発生部38は、位置信号作成 回路29で作成した位置信号から実速度信号を発生させ る(実速度を測定する)ものである。

(3):速度誤差信号作成部39は、目標速度発生部37 から出力される目標速度と、実速度発生部38から出力 される実速度との差(目標速度-実速度)を求め、この 値を速度誤差信号として出力するものである。

【0058】(4):出力部40は、切り替え信号(VC M制御部内で発生する信号)により、前記速度誤差信号作成部39から出力される速度誤差信号と、位置信号との切り替えを行うものである。

【0059】なお、速度誤差信号を出力する場合、速度 誤差信号と定数との積を演算して出力する。また、出力 部40の出力信号は、VCM指示電流値としてDAC2 4へ出力される。

【0060】前記VCM制御部35の動作は、次の通りである。シーク制御を行う場合、先ず、VCM6に対し速度制御を行い、その後、磁気ヘッド7が目標シリンダ付近に達すると、位置制御(ファイン制御)を行って位置決めする。

【0061】そこで先ず、前記速度制御を行うが、この

時、目標速度発生部37で目標速度を発生し、実速度発生部38では、実速度を発生する。そして、速度誤差信号作成部39により、目標速度と、実速度とから、目標速度-実速度の演算を行い、演算結果の値を速度誤差として出力する。

【0062】次に、出力部40では、速度誤差信号作成部39から出力された速度誤差と定数との積を求める演算を行い、その演算結果の値をVCMの指示電流値としてDAC24に出力する。以上の処理により、速度制御を行う。

【0063】その後、磁気ヘッド7が目標シリンダ付近に達すると、切り替え信号により出力部40が切り替えられ、DAC24には位置信号が出力される。これにより、位置制御が行われ、磁気ヘッド7を目標位置に位置決めする。

[0064]

§ 3:DEの構成の説明・・・図4、図5参照 図4はDE内部の平面図、図5はDEの一部断面図であ る。前記DEの内部は図示のように構成されている。

【0065】図示のように、DE2には、ベース50 と、カバー51が設けてあり、その内部には、複数の磁 気ディスク5がスピンドル4に取り付けられており、そ の周辺部には、VCM6が設けてある。

【0066】このVCMは、コイル49、磁気回路47、磁石46等で構成され、コイル49が可動できるように構成されている。そして、前記コイル49は、キャリッジ43の一端に設けたコイル支持部52に固定されており、キャリッジ43は、ペアリング45を介して、シャフト44を中心として回転するように構成されている。

【0067】また、前配キャリッジ43の先端部(コイル支持部52と反対側)には、磁気ヘッド7が設けてあり、キャリッジ43により磁気ディスク5の半径方向に移動できるように構成されている。

【0068】前記VCM6を駆動する場合、コイル49に電流を流すと、その駆動電流の向きと大きさに応じた電磁力が発生し、該コイル49を取り付けたキャリッジ43がシャフト44を中心として回転する。このキャリッジ43の回転により、磁気ヘッド7は磁気ディスク5の半径方向に移動し、シーク動作が行われる。

[0069]

§ 4:メモリ内容の説明・・・図6参照

図 6 はメモリ内容の説明図であり、図 6 A は R O M の内容、図 6 B は R A M の内容を示した図である。

【0070】過熱対策制御を行う際、サーボコントローラ18は、ROM23、及びRAM22にアクセスして制御を行う。この場合ROM23には、予めデータを格納しておく。またRAM22には制御を行う際、検出データ等、各種のデータを格納しておく。

【0071】前記ROM23に格納するデータとして

は、図示のようなK(定数)、 $\theta$ (熱抵抗による定数)、 $C_V$ (測定対象の熱容量)、 $T_e$ (周囲の環境温度)、 $t_s$ (サンブリング時間)、a(定数)、b(定数)等のデータである。これらのデータは、予めROM23に格納しておき、装置運用時に、サーボコントローラ18内のVCM制御部35が読み出して使用する。【0072】また、RAM22に格納するデータとしては、図示のような $I_V$ (VCM電流指示値)、 $\Delta Q_V$ (温度上昇分の熱量)、 $\Delta Q_V$ (自然放熱分の熱量)、 $Q_V$ (測定対象の熱量)、 $T_V$ (測定対象の温度)等のデータである。更に、RAM22には、タイマ(ソフトタイマ)を設定する。

[0073]

§ 5: 温度検出処理と熱対策制御時の説明 サーポコントローラ18のVCM制御部35では、VC M6の制御を行うが、その際、温度検出処理を実行し、 検出結果のデータをRAM22に格納しておく。以下、 この温度検出処理について説明する。

【0074】前記VCM制御部35は、磁気ヘッド7の位置の検出と、VCM電流値の制御を行うために、定時間間隔で割り込み処理を行っている。この割り込みの時間間隔は、例えば、66μsec程度の値である。

【0075】すなわち、VCM制御部35は、通常、上位コントローラ17からのシーク命令の監視等の処理を行っているが、定時間間隔で割り込みが発生し、現在行っている処理を中断して割り込み処理を行う。

【0076】この割り込み処理の中で、磁気ヘッド7の位置検出を行い、VCM6に流す電流値の制御を行う。 これにより、一定時間おきにVCM制御部35の認識している位置と、電流値を更新している。

【0077】温度の検出も、前記の割り込み処理の中で行う。この場合、前回の割り込み処理からの経過時間(一定時間の割り込み間隔:これを「サンプリング時間」という)と、流した電流値、及び測定対象の熱容量により、温度の変化量として計算し、これを新たな温度としてRAM22に格納しておく。

【0078】そして、過熱対策制御時のシークを実行する時は、前配RAM22に格納されているデータを読み出して実行する。この場合のシーク制御方法としては、次のような方法がある。

【0079】①:第1のシーク制御方法は、シーク実行時に、検出温度が基準値よりも大きかったら、その値に応じてシークの開始を遅らせる方法である。このようにすれば、温度上昇を抑制することができる。

【0080】②:第2のシーク制御方法は、1つのシーク動作を、複数のシーク動作に分割して行う方法である。また、前配シーク制御とは別に、検出した温度を利用して、冷却ファンの回転の開始、終了、及び回転数制御を行う。この場合、冷却ファンの回転数を切り替えるタイミングは、前配割り込み処理の中で行っても良い

し、もっと間隔の長い別のタイミングの割り込み処理の 中で行っても良い。

【0081】§6:フローチャートに基づく温度検出処理の説明・・・図7参照

図7は温度検出処理フローチャートである。以下、図7に基づいて、前記VCM制御部35が行う温度検出処理について具体的に説明する。なお、S1~S5は処理ステップを示す。

【0082】以下の処理は、VCM制御部35が実行するが、その際、図6に示したROM23、及びRAM22のデータが格納されているものとして説明する。なお、装置の電源投入時には、ROM23から、 $T_e$ (周囲の環境温度)を読み出し、この値 $T_e$ を $T_V$ (測定対象の温度)の初期値として、RAM22に格納しておく。

【0083】先ず、VCM電流指示値を $I_{\gamma}$ とし(S 1)、この $I_{\gamma}$ を2乗した値( $I_{\gamma} \times I_{\gamma}$ )と、定数 K、及びサンプリング時間  $t_s$ との乗算を行うことにより、温度上昇分の熱量 $\Delta Q_{\gamma i}$ を求め( $\Delta Q_{\gamma i}$ =K $\times I_{\gamma}$  $\times I_{\gamma} \times t_s$ )、RAM 2 2 に格納する(S 2)。

【0084】次に、測定対象の温度 $T_v$ 、周囲の環境温度 $T_e$ 、定数 $\theta$ 、サンプリング時間  $t_s$ を使用して、

 $(T_V - T_e) / \theta \times t_S$ の演算を行い、自然放熱分の 熱量 $\Delta Q_{V2} = (T_V - T_e) / \theta \times t_S$ を求め、RAM 22に格納する(S3)。

【0085】続いて、温度上昇分の熱量 $\Delta Q_{Y1}$ から、測定対象の自然放熱分の熱量 $\Delta Q_{Y2}$ を差し引いた値を積分する( $Q_V \leftarrow Q_V + \Delta Q_{V1} - \Delta Q_{V2}$ )ことにより、前記測定対象の熱量 $Q_V$ を求め、RAM22に格納する(S4)。

【0086】最後に、前記新しい測定対象の熱量Q  $_{\text{V}}$  と、測定対象の熱容量 $C_{\text{V}}$  とを使用し、 $Q_{\text{V}}$   $/C_{\text{V}}$  の 演算を行って、新しい温度 $T_{\text{V}} = Q_{\text{V}}$   $/C_{\text{V}}$  を求め、R AM22に格納する(S5)。

 $[0\ 0\ 8\ 7]$  以上の処理をサンプリング時間  $t_s$  毎に行って、温度 $T_V$  を検出し、検出したデータをRAM  $2\ 2$  に格納しておく。そして、シーク制御を行う時に、RAM  $2\ 2$  のデータを読み出して制御を行う。

[0088]

§7:シーク制御の説明・・・図8参照

図8はシーク制御の説明図である。VCM制御部35では、上位装置からのシーク命令によりシーク制御を行うが、その際、本実施例では、前配第1のシーク制御方法、すなわち、シーク実行時に、検出した温度が基準値よりも大きかったら、その値に応じてシークの開始を遅らせる方法で実施する。以下、このシーク制御方法について詳細に説明する。

【0089】例えば、図の横軸を温度 $T_v$ 、縦軸をディレイ $\Phi$ Dとした座標とする。そして、シークの開始を遅らせるディレイ $\Phi$ Dを $\Phi$ D= $\Phi$ Tv- $\Phi$ Dの直線とする(但

し、a、bはROM23に格納されている定数)。

【0090】この場合、ディレイ量Dは、温度 $T_{\gamma}$ により次のように変化する。すなわち、温度 $T_{\gamma}$ に対する基準値をT1とし、 $T_{\gamma} \leq T1$ の領域ではD=0、 $T_{\gamma} > T1の領域では、<math>D=a$   $T_{\gamma}-b$  となる。

【0091】従って、シークを行う場合、温度 $T_v$ が基準値T1以下なら、シーク命令を受けたら直ちにシークを行い、温度 $T_v$ が基準値T1を越えていたら、その温度 $T_v$ に比例したディレイ量だけ遅らせてシークを行う。

[0092]

§8:シーク時の処理説明・・・図9、図10参照 図9はシーク時の処理フローチャート1、図10はシーク時の処理フローチャート2である。以下、図9、図10に基づいて、サーボコントローラ内のVCM制御部が行うシーク時の処理を説明する。なお、S11~S23は処理ステップを示す。

【0093】上位装置からのシークコマンドを受け取ると(S11)、VCM制御部35は、RAM22に格納されている温度 $T_v$ を参照し(S12)、この温度 $T_v$ と、予め設定してある基準値T1との比較を行う(S13)。

【0094】その結果、 $T_V > T$ 1なら(S14)ディレイ量Dを、 $D=aT_V-b$ の式に従った値として決定する( $T_V$ に比例したディレイ量Dを演算等で求める)(S16)。そして、前記処理で決定したディレイ量Dをタイマ(RAM22のタイマ)に設定する(S17)。

【0095】続いて、前記タイマをスタートさせ(S18)、前記の設定時間Dが経過すると(S19)、VCM制御部35は、シークを開始する(S20)。また、前記処理(S14)で、D=0ならば、直ちにシークを行う(S20)。

【0096】シークが開始されると、先ず、VCMの速度制御を行い(S21)、目標シリンダ付近に達すると(S22)、位置制御を行って(S23)シーク動作を終了する。

[0097]

89:速度制御時の説明・・・図11参照 図11は速度制御時の処理フローチャートである。以 下、図11に基づいて、前記速度制御時の処理(S21

で、図11に基づいて、前に速度前時やの処理(321 の詳細な処理)を説明する。なお、この処理は前記VC M制御部35が行う処理であり、S31~S33は処理 ステップを示す。

【0098】先ず、目標速度と、実測で求めた実速度とから、目標速度-実速度の演算を行い、演算結果の値を速度誤差として求める(S31)。この場合、目標速度は、残りシリンダ数に応じた値をテーブル参照により求めた値である。

【0099】次に、前記処理で求めた速度誤差と定数と

の積を求める演算を行い、その演算結果の値をVCMの 指示電流値として求める(S32)。そして、前記指示 電流値(VCM電流値)をDACに設定する。以上の処 理により、前記速度制御を行う。

[0100]

§10: VCM電流、温度波形の説明・・・図12参照図12はVCM電流、温度波形図1である。図において、①はVCM電流値の波形、②は検出温度を示す波形である。また、t1、t2、t3、t4・・・は各タイミングを示す。

【0101】図12に示した波形は、シークコマンドが 連続して発行された場合に、前記第1のシーク制御方法 でシーク制御を行った時の波形である。このシーク制御 方法では、シーク制御時には、検出温度が基準値よりも 大きかったら、その値に応じてシークの開始を遅らせて 制御を行う。

【0102】例えば、シークコマンドが発行されたt1では、検出温度は基準値より低い値である。従って、直ちに図示のVCM電流値を設定してシーク制御を行う。シークコマンドが発行されたt2では、検出温度は基準値より低い値である。従って、直ちに図示のVCM電流値を設定してシーク制御を行う。

【0103】シークコマンドが発行された t3では、検出温度は基準値より高い値である。この場合、 t3から D1だけシークを遅らせる。そして、 t3+D1後の t4でシーク制御を行う。この場合、D1は t3での温度  $T_V$ の値により $D1=aT_V-b$ の式に従って求める (図8参照)。

【0104】シークコマンドが発行された t5では、検出温度は基準値より高い値である。この場合、 t5から D2だけシークを遅らせる。そして、 t5+D2後の t6でシーク制御を行う。この場合、D2は t5での温度  $T_v$  の値により $D2=aT_v-b$ の式に従って求める。

【0105】以上のようにして、シークコマンドが発行された場合、シークとシークの間にインターパルを入れたシーク制御を行う。この制御により発熱を抑えることができる。

[0106]

§ 11:VCM電流、温度波形の説明・・・図13参照図13はVCM電流、温度波形図2である。図において、①はVCM電流値の波形、②は検出温度を示す波形である。また、t1、t2、t3、t4・・・は各タイミングを示す。

【0107】図13に示した波形は、シークコマンドが 連続して発行された場合に、前配第2のシーク制御方法 でシーク制御を行った時の波形である。このシーク制御 方法では、シーク制御時に、1回のシーク動作を複数の シーク動作に分割して行う。

【0108】例えば、シークコマンドが発行されたt1では、検出温度は基準値より低い値である。従って、直

ちに図示のVCM電流値を設定して、通常のシーク制御 を行う。

【0109】シークコマンドが発行された t 2では、検出温度は基準値より低い値である。従って、直ちに図示のV C M電流値を設定して、通常のシーク制御を行う。シークコマンドが発行された t 3では、検出温度は基準値より高い値である。この場合、1回のシークを、 t 3と t 4とに分割して行う。この方法では、例えば、磁気へッドをAからBまで移動させる場合、AからBへ直接移動させるのではなく、 t 3のシークで、AからC(ただし、C は A、Bの間の位置)まで移動させ、その後、 t 4のシークでCからBへ移動させる。

【0110】このような分割シークを実行することにより、VCM電流値のピーク値が小さくなるため、発熱が抑制可能となる。その後、シークコマンドが発行された t5では、検出温度は基準値より低い値である。従って、直ちに図示のVCM電流値を設定して、通常のシーク制御を行う。

【0111】以上のようにして、シークコマンドが発行された場合、1つのシークを複数に分割してシーク制御を行う。この制御により発熱を抑えることができる。

§ 12:その他の機能等の説明

前記の磁気ディスク装置には、次の機能を備えている。

【0112】①:前記検出したVCMの温度を用いて、装置の冷却ファンの回転の開始、停止、及び回転数の制御を行う機能を持たせる。この場合、冷却ファンの制御は、サーボコントローラ18が、RAM22のデータを参照して行う。

【0113】②:前記サーボコントローラ18が実行する過熱対策制御において、温度の上昇、又は低下による低発熱制御(前配実施例の処理)の開始、終了、及びその処理の内容を、サーボコントローラ18から、上位コントローラ17へ報告し、更に上位コントローラ17からホストへ報告する機能を持たせる。

【0114】③:前記サーボコントローラ18が実行するVCMの過熱対策制御の機能を、ホスト(上位装置)から、コマンド、或いはスイッチ等により設定したり、或いは解除したりできる機能を持たせる。

【0115】(他の実施例)以上実施例について説明したが、本発明は次のようにしても実施可能である。

①:前記検出温度に基づく冷却ファンの制御は、前記第 1のシーク制御方法、或いは第2のシーク制御方法によるシーク動作と同時に実行しても良く、また別々に実行 しても良い。

②:冷却ファンは、磁気ディスク装置全体を冷却するものでも良く、またDE部分を冷却するものでも良い。

[0116]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば次のような効果がある。

①: VCMの温度を検出する場合、自然放熱分の熱量を

考慮して検出しているので、常に正確なVCMの温度を 検出することができる。

【0117】②: VCMに大きな電流を流し続けた場合 でも、正確に破壊の危険を予測することができる。従っ て、VCMが温度上昇によって破壊する事態は回避する ことが可能である。

【0118】 ③: 装置のスループットの低下を最小限に 抑えて、VCMの放熱を効果的に行うことができる。

④:検出した温度に応じて、冷却ファンの制御を行うこ とにより、VCMの放熱を、更に効果的に行うことがで きる。

【0119】 ⑤: 温度の上昇、または低下による低発熱 制御(前記実施例の制御)の開始、終了、及びその処理 の内容を上位装置(ホスト)に報告することにより、上 位装置では、その状態を認識することが可能となり、効 率の良い制御を行うことができる。

【0120】⑥:前記VCMの過熱対策制御の機能を、 上位装置から、コマンド、或いはスイッチ等により設定 したり、或いは解除したりすることができるので、処理 の内容等に応じた適切な制御機能を選択することが可能 になり、より柔軟な対応が図れる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の原理説明図である。

【図2】実施例における磁気ディスク装置のブロック図 である。

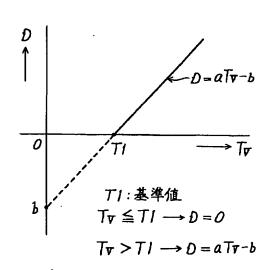
【図3】実施例におけるサーボコントローラの説明図で ある。

【図4】実施例におけるDE内部の平面図である。

【図5】実施例におけるDEの一部断面図である。

[図8]

## シーク制御の説明図



【図6】実施例におけるメモリ内容の説明図である。

【図7】 実施例における温度検出処理フローチャートで ある。

【図8】実施例におけるシーク制御の説明図である。

【図9】実施例におけるシーク時の処理フローチャート 1である。

【図10】実施例におけるシーク時の処理フローチャー ト2である。

【図11】実施例における速度制御時の処理フローチャ ートである。

【図12】実施例におけるVCM電流、温度波形図1で ある。

【図13】実施例におけるVCM電流、温度波形図2で ある。

【図14】従来の磁気ディスク装置の説明図である。

【図15】従来の温度検出処理説明図である。

【図16】従来のVCM電流、温度波形図である。 【符号の説明】

2 DE (ディスクエンクロージャ)

スピンドルモータ

スピンドル

磁気ディスク(媒体)

VCM (ポイスコイルモータ)

磁気ヘッド

14 温度検出部

位置決め制御部

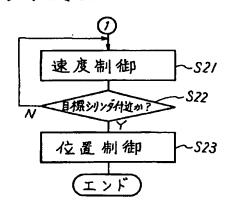
18 サーボコントローラ

2 2 RAM

3 5 VCM制御部

[図10]

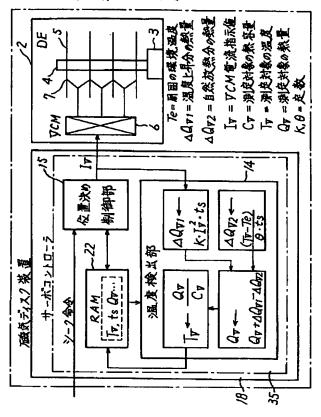
## シーク時の処理フローチャート 2



【図1】

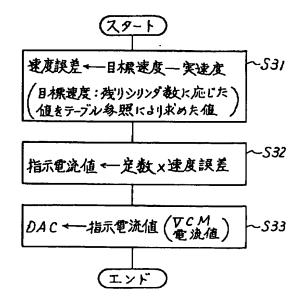
【図2】

### 本発明の原理説明図



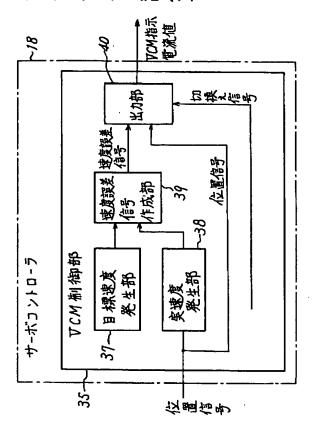
【図11】

## 速度制御時の処理フローチャート



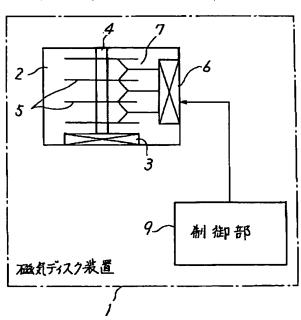
【図3】

## サーボコントローラの説明図



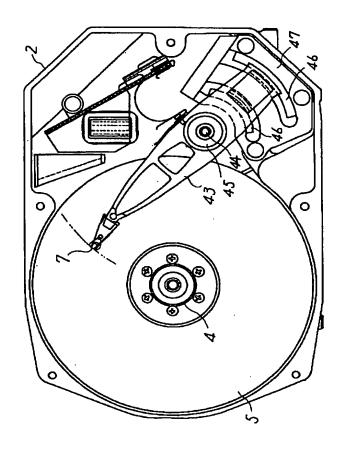
【図14】

## 従来の磁気ディスク装置の説明図



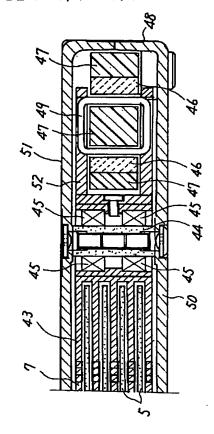
【図4】

## DE内部の平面図



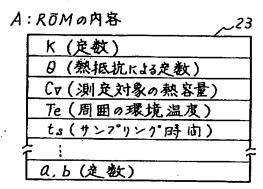
【図5】

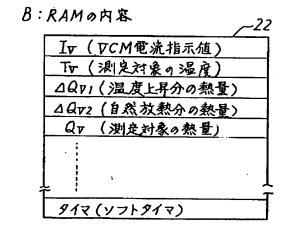
DEの一部断面図



【図6】

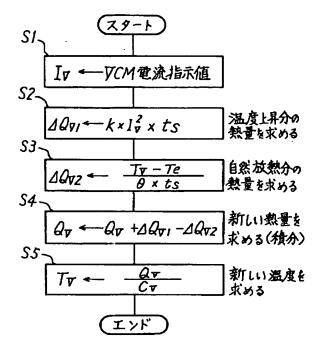
メモリ内容の説明図





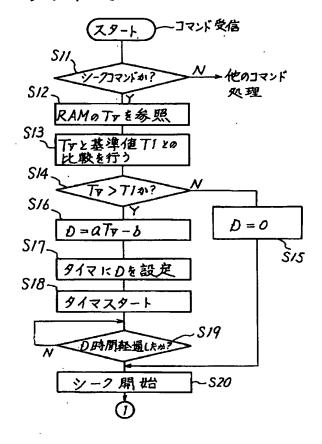
[図7]

## 温度検出処理フローチャート



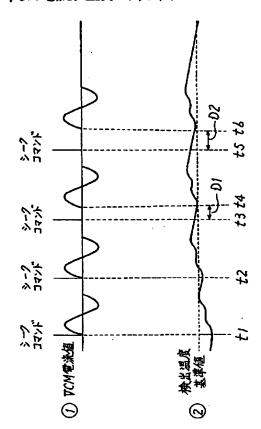
### 【図9】

## シーク時の処理フローチャート1



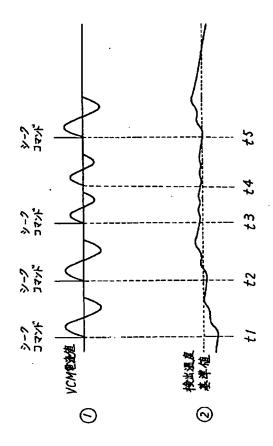
【図12】

VCM電流.温度波形図 1



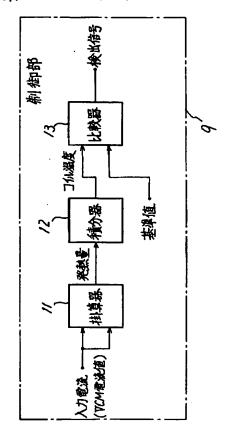
【図13】

## PCM电流,温度波形图 2



[図15]

従来の温度検出処理説明図



【図16】

# 從来のVCM電流,温度波形図

